

REPUBLICA MOLDOVA



(19) Agenția de Stat
pentru Protecția Proprietății Industriale

(51) Int. Cl.⁷: H 01 L 21/203

(12) CERERE DE BREVET DE INVENȚIE

(21) Nr. depozit: a 2000 0111 (22) Data depozit: 2000.06.27 (41) Data publicării cererii: 2002.07.31, BOPI nr. 7/2002	
(71) Solicitant: VIERU Stanislav, MD (72) Inventatori: VIERU Stanislav, MD; IACOVLEV Vladimir, MD; SIRBU Alexei, MD; CALIMAN Andrei, MD; SURUCEANU Grigore, MD; MEREUȚĂ Alexandru, MD	

(54) Dispozitiv pentru clivarea in vid a structurilor epitaxiale semiconductoare

(57) Rezumat:

1

Invenția se referă la dispozitivele de producere și prelucrare a semiconductoarelor, în special la un dispozitiv de clivare in vid a structurilor epitaxiale semiconductoare care efectuează și depunerea straturilor dielectrice protectoare pe suprafețele proaspăt clivate.

Dispozitivul conține o măsă constituită din două părți, una executată mobilă și rabatabilă. Inițial pe măsă se instalează placheta semiconductoare. Prin intermediul unor parghii acționate din exteriorul camerei de vid, partea mobilă a măsă se rotește, clivând astfel structura epitaxială. După rotire, partea rabatabilă

2

5 a măsă și respectiv așchiile clivate din structura epitaxială se situează sub un unghi de 45° față de direcția de propagare a fluxului de vapori de substanță protectoare. Precizia și calitatea clivării sunt asigurate prin ajustarea preliminară a structurii in camera de vid, prin intermediul unui

10 microscop.

Revendicări: 1

Figuri: 3

15

Șef Secție:

COZMA Valeriu

Examinator:

NASTAS Xenia

Redactor:

LOZOVANU Maria